事業概要 および連結財務ハイライト

■事業概要および連結財務ハイライト

事業概要および連結財務ハイライト

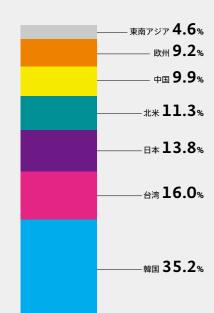
半導体製造装置

コータ/デベロッパ エッチング装置 ■洗浄装置

ウェーハプローバ

成膜装置

地域別売上構成比



スマートフォン、タブレットなどのモバイル端末や、ビッグデータの処理に必要不可欠なデータセンター向けサーバに多く使用されている半導体。今後さらに、IoT時代の到来により、家電製品、自動車、医療、ヘルスケアなど、あらゆる分野で半導体の用途が拡大していきます。東京エレクトロンは、これら半導体の生産を担う多彩な半導体製造装置を、優れた技術サポートとともに提供しています。主な製品ラインアップとして、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、エッチング装置、成膜装置、洗浄装置と、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバを取り揃えています。また、先端パッケージング工程に用いられるめっき装置、ウェーハボンディング/デボンディング装置なども取り扱っています。



コータ/デベロッパ CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro™ Z



プラズマエッチング装置 Tactras™



ALD装置 NT333™



枚葉成膜装置 Triase^{+™}



ウェーハプローバ Precio™ XL

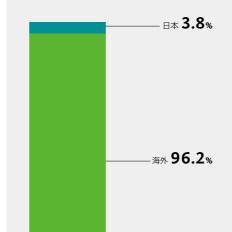
FPD製造装置

FPDコータ/デベロッパ

■ FPDエッチング/アッシング装置

■有機ELパネル製造用インクジェット描画装置

地域別売上構成比



フラットパネルディスプレイ(FPD)は、テレビはもとより、スマートフォンやタブレットなどに使用されている、私たちの日常に欠かせない存在です。今後はVR(仮想現実)/AR(拡張現実)向けヘッドマウントディスプレイなど、新たな需要拡大が予想されています。その生産を担うFPDコータ/デベロッパ、エッチング/アッシング装置を確かな技術サポートとともに提供しています。また、今後の有機ELディスプレイの市場拡大に向けて、大型基板対応の有機ELパネル製造用インクジェット描画装置も取り揃えています。



FPDコータ/デベロッパ Exceliner™



FPD プラズマエッチング / アッシング装置 Betelex™



有機 ELパネル製造用 インクジェット描画装置 Flius™ 2500

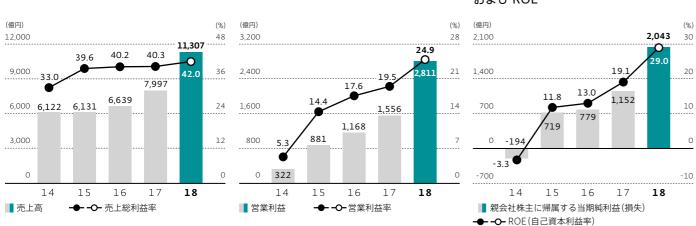
売上高および売上総利益率

営業利益および営業利益率

親会社株主に帰属する当期純利益(損失) および ROE

枚葉洗浄装置

CELLESTATM -i



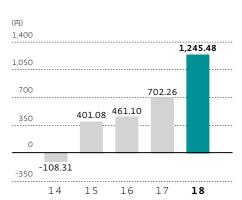
2016年3月期以前まで四捨五入にて表示しています億円、百万円、千円及び千ドル単位未満の金額並びに千株単位未満の株数は、本レポートの2017年3月期より切り捨てて表示しています。このため、2017年3月期以降においては、合計値が各項目に表示された数値の合計と一致しない場合があります。

フリーキャッシュフロー

(億円) 1,600 1,397 1,200 1,180 800 800 642 604 400 334 0 14 15 16 17 18

フリーキャッシュフロー = 営業活動による キャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー (取得から満期日までが1年内の短期投資などの増減額を除く)

1株当たり当期純利益(損失)



1株当たり配当金

